

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης Νανοτεχνολογίας



Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής

# Σύνθεση και μελέτη σιδηροηλεκτρικού Hf<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>O σε υποστρώματα Ge με εναπόθεση μοριακής δέσμης

### Χριστίνα Ζαχαράκη

Επιβλέπων διατριβής: Α. Δημουλάς

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης-Ημερίδα Υποψήφιων Διδακτόρων 2019

### Δομή παρουσίασης

≻Εισαγωγή

≻Παρασκευή TiN/HZO/Ge πυκνωτών (MFS)

- > Μέθοδοι χαρακτηρισμού
- Μετρήσεις πόλωσης
- > Σύνοψη/μελλοντικά σχέδια

## Εισαγωγή

HfO<sub>2</sub>

χρησιμοπείται σαν διηλεκτρικό πύλης στα τρανζίστορ τεχνολογίας CMOS

πρόσφατα βρέθηκε ότι είναι σιδηροηλεκτρικό υλικό όταν κρυσταλλωθεί στη μη κεντροσυμμετρική ορθορομβική δομή Pbc2<sub>1</sub>

γ κραματοποίησή του με Zr ή η νόθευσή του με Si, Ge, Al, κ.α. σταθεροποιεί την ορθορομβική φάση (σιδηροηλεκτρική δομή) ή την τετραγωνική (αντισιδηροηλεκτρική).



- <u>χαμηλή Τ</u>: πιο σταθερή η μονοκλινική φάση
- <u>υψηλή Τ</u> με προσμίξεις: σταθεροποιείται η τετραγωνική

τετραγωνική επέκταση γονοκλινική

στρώμα κάλυψης (συνήθως TiN) εμποδίζει την επέκταση ασκώντας τάση στο πλέγμα

σταθεροποιείται η ορθορομβική (ενδιάμεση φάση)

### <u>Εφαρμογές</u>



αυθόρμητη πόλωση ±Ps για αποθήκευση
 δεδομένων (καταστάσεις «0» και «1»)

 ✓ κατασκευή FeFETs (Ferroelectric Field Effect Transistor) χάρη στη συμβατότητα με την τεχνολογία πυριτίου και των σταθερών σιδηροηλεκτρικών ιδιοτήτων σε μικρά πάχη (5-30nm)

 προοπτική για εφαρμογή σε ενσωματωμένες μη πτητικές μνήμες\*, χαμηλότερης ισχύος και μεγαλύτερης ταχύτητας (άρα μικρότερης ενέργειας) και μεγαλύτερης ηλεκτρικής αντοχής

\*βασικό μέρος στις αναπτυσσόμενες συσκευές IoT (Internet of Things)

### <u>Γιατί Ge;</u>

✓ μεγαλύτερη διαφορά συντελεστών θερμικής διαστολής Ge-HZO → Ge συστέλλεται
 γρηγορότερα καθώς ψύχεται → εφελκυστικές τάσεις σταθεροποιούν ορθορομβική φάση

$$\gamma_{HZO} \sim 1 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

$$\gamma_{Ge} = 5.9 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$$

$$\delta \gamma = 4.1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$$

$$\varepsilon \approx + \delta \gamma \cdot \delta T \approx 0.3\%$$

$$\delta T = T_{ann} - T_{room} = 725 \text{ K}$$

✓ HZO/Ge διεπιφάνειες καθαρές, (Hf)GeO<sub>x</sub> δεν είναι σταθερό, διασπάται εύκολα σε χαμηλές T (σε αντίθεση με το SiO<sub>x</sub>) → δεν παγιδεύονται φορτία → βελτίωση της ηλεκτρικής αντοχής και του παραθύρου μνήμης στα FeFETs

 ✓ Ge ημιαγωγός με μικρό ενεργειακό χάσμα, πολλούς ελεύθερους φορείς → θωρακίζουν τα φορτία πόλωσης →σταθεροποιούν σιδηροηλεκτρικές περιοχές

## Παρασκευή MFS πυκνωτών



εξάχνωση Hf και Zr από δύο κανόνια ηλεκτρονίων παρουσία ατομικού οξυγόνου από πηγή πλάσματος (πιο δραστικό από μοριακό οξυγόνο) στους 225°C σε θάλαμο υψηλού κενού



εξάχνωση Τi παρουσία ατομικού N σε RT και γρήγορη θερμική ανόπτηση (RTA) στους 750°C για 20sec

εναπόθεση Ti/Pt επαφών με μάσκα ή οπτική λιθογραφία

διάλυμα NH<sub>4</sub>OH/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>O

## High Resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM)\*





ΗΖΟ και ΤΙΝ ομοιόμορφα και συνεχή στρώματα

ακριβής προσδιορισμός t\_{HZO} =13nm

HZO πολλυκρυσταλλικά με μέγεθος κόκκων 20-30nm

καθαρή, κρυσταλλική διεπιφάνεια HZO/Ge ----->

ενισχύει την επιθυμητή εφελκυστική τάση κατά την ψύξη



SAED (Selected Area Electron Diffraction ) pattern:

ανιχνεύονται κορυφές περίθλασης ορθορομβικής φάσης HZO (111), ενώ μονοκλινικής όχι

<sup>\*</sup>R. Negrea, and L. Pintilie, National Institute for Materials Physics, Romania

### Προσδιορισμός πάχους ΗΖΟ

### Προσδιορισμός συγκέντρωσης Zr/Hf



<sup>\*</sup>Μ. Αξιώτης, και Α. Λαγογιάννης, Tandem, Δημόκριτος

#### X-ray Photoelectron Spectroscopy για τον έλεγχο του TiN top electrode



>σχεδόν στοιχειομετρικό (N/Ti ≈ 1.1-1.2)

≻μικρή κορυφή N-O-Ti → θεωρείται ότι έλλειψη οξυγόνου (V<sub>o</sub>) στο HZO οφελεί την ορθορομβική φάση

## Μετρήσεις πόλωσης



 $I = A \begin{pmatrix} \frac{dP}{dV} & \frac{dV}{dt} & \sigma \cup \mu \mu \\ & \checkmark & \checkmark & \mu \epsilon \eta \\ \rho eak \sigma to E_c & o \rho \theta o \\ \delta \pi o \cup \gamma (v \epsilon t \alpha t) \\ \eta \sigma t \rho \epsilon \psi \eta & \checkmark & \mu \epsilon \eta \\ \tau \eta \varsigma & \alpha t \epsilon \lambda s \\ \pi \delta \lambda \omega \sigma \eta \varsigma & \epsilon \cup v o \\ \sigma t \delta \eta \rho \end{pmatrix}$ 

✓ βρόχος υστέρησης: πλατύς και συμμετρικός

 ✓ μεγάλα P<sub>r</sub> λόγω της επικράτησης της ορθορομβικής φάσης

✓ μεγάλο Ε<sub>c</sub> λόγω των μειωμένων
 ατελειών στη διεπιφάνεια (οι ατέλειες
 ευνοούν τη δημιουργία και στρέψη των
 σιδηροηλεκτρικών περιοχών)

(+) αυξημένο παράθυρο μνήμης MW=2 $d_{\rm HZO}$ E<sub>c</sub> =4.7V

(-) πιο κοντά στο πεδίο κατάρρευσης (4-5 MV/cm στα HZO)

### Μέθοδος Positive Up Negative Down



• διορθωμένες καμπύλες: ιδανική μορφή, φαίνεται ο κορεσμός

• μικρή διόρθωση του  $P_r$  (38.5  $\rightarrow$  33.6 μC/cm<sup>2</sup>), άρα μικρό ποσοστό παρασιτικών φαινομένων

### Μετρήσεις fatigue cycling



Μικρό ή καθόλου wake-up

 ✓ Fatigue μετά από 10<sup>3</sup> κύκλους και breakdown 10<sup>5</sup> στα 2.3 MV/cm (καλό συγκριτικά με βιβλιογραφία)

Για μεγαλύτερα πεδία (3.1 MV/cm)
 σπάει μετά από 1000 κύκλους και η
 καμπύλη υστέρησης «ανοίγει» στα
 αρνητικά V λόγω ρεύματος διαρροής



## Σύνοψη

Σύνθεση MFS πυκνωτών σε υποστρώματα Ge με καλή σιδηροηλεκτρική συμπεριφορά:

> συμμετρικός βρόχος υστέρησης και μεγάλη παραμένουσα πόλωση P<sub>r</sub> → διευκολύνει την "ανάγνωση" της κατάστασης πόλωσης

≻ μεγάλο συνεκτικό πεδίο → μεγάλο παράθυρο μνήμης

δεν χρειάζεται wake-up

≻καθαρές διεπιφάνειες HZO/Ge → αποφεύγεται η παγίδευση φορτίων → βελτίωση της ηλεκτρικής αντοχής

## Μελλοντικά σχέδια

- Εμβάθυνση στην κατανόηση των μηχανισμών στα σιδηροηλεκτρικά ΗΖΟ
- Δοκιμή σε υποστρώματα Ge μικρότερης νόθευσης
- ≻ Κατασκευή FeFET



Y. Goh, and S. Jeon, *Nanotechnology* **29**, 335201 (2018)

## Ευχαριστίες

### <u>Συμβουλευτική επιτροπή</u>:

Α. Δημουλάς Β. Λυκοδήμος Κ. Σιμσερίδης

### Ομάδα στο Εργαστήριο Μοριακής Επιταξίας και Επιστήμης Επιφανειών:

Π. Τσίπας Δ. Τσούτσου Σ. Χαΐτογλου Σ. Φράγκος Ε. Ξενογιαννοπούλου Ι. Hauge



Η εργασία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020-3eFERRO